



3D Patterning Laser System

- ▶ Laser beam을 sample에 조사하여 3D patterning을 하기 위해 고안된 광학시스템
- ▶ 355nm, 405nm 두 파장의 레이저 빔이 하나의 sample에 조사되도록 해 어느 한 파장을 사용 할 때 realignment 할 필요 없도록 구성되어 있음
- ▶ Spatial filter 사용 해 noise를 제거해 레이저 빔의 공간모드의 purity가 좋음

